# Диэлектрическая проницаемость и проводимость на переменном токе полуизолирующих полупроводников Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te

© П.В. Жуковский, А. Родзик,\* Ю.А. Шостак<sup>†</sup>

Люблинский технический университет, Люблин, Польша \* Ягеллонский университет, Краков, Польша <sup>†</sup> Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Белоруссия

(Получена 11 июля 1995 г. Принята к печати 25 октября 1996 г.)

Приведены температурные зависимости диэлектрической проницаемости и сопротивления на переменном токе соединений  $Cd_{1-x}Mn_xTe$  ( $0 \le x \le 0.7$ ), из которых установлено, что дополнительная поляризация соединения обусловлена прыжковой перезарядкой дефектов структуры. Исследованы спектры электронного парамагнитного резонанса и отражения света для этих материалов. Предложена модель, описывающая термически активируемый рост диэлектрической проницаемости полупроводников. Определены основные характеристики и предложена микроскопическая модель структуры дефектов, прыжковая перезарядка которых приводит к росту диэлектрической проницаемости компенсированных полупроводников  $Cd_{1-x}Mn_xTe$ .

#### Введение

При высоких концентрациях дефектов, вносящих глубокие уровни в запрещенную зону, в полупроводниках могут проявляться динамические эффекты, обусловленные прыжковым обменом зарядами между дефектами [1]. Одним из таких эффектов является обнаруженный нами температурно-активируемый рост диэлектрической проницаемости в кристаллах Si, облученного дозами нейтронов более или порядка 10<sup>18</sup> см<sup>-2</sup> [2]. Прыжковый обмен электронами между имеющимися в кристалле дефектами приводит к появлению диполей, а следовательно, к росту диэлектрической проницаемости [3]. В бинарных и тройных соединениях дефекты возникают не только в результате облучения, но и в процессе выращивания [4]. Их прыжковая перезарядка также может приводить к росту диэлектрической проницаемости кристаллов.

В данной работе представлена феноменологическая модель, описывающая рост диэлектрической проницаемости сильно дефектных полупроводников, обусловленный прыжковой перезарядкой дефектов, приведены результаты измерений диэлектрической проницаемости и проводимости на переменном токе, а также спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) полупроводников  $Cd_{1-x}Mn_xTe$ , что позволило предложить микроскопическую модель структуры дефектов, между которыми происходит прыжковый обмен зарядами.

## 1. Прыжковый обмен зарядами и диэлектрическая проницаемость сильно дефектных полупроводников

При построении модели будем исходить из того, что в кристалле существует один тип дефектов, которые вносят глубокие уровни в запрещенную зону, а зарядовые состояния дефектов могут принимать значения "0", "+" и "-". Такие дефекты характерны для полупроводников  $A^{II}B^{VI}$  [5]. При низких температурах доминирующая часть этих дефектов будет находиться в нейтральном зарядовом состоянии. С ростом температуры может начаться прыжковый обмен зарядами между дефектами. При этом прыжки осуществляются в основном между ближайшими соседями [6]. Средняя длина прыжка  $R \simeq N^{-1/3}$ , где N — концентрация дефектов. Диполь, возникающий в результате прыжка, имеет момент p = eR. Вероятность прыжковой перезарядки определяется, согласно [7]:

$$P(T) = c(\alpha R)^2 \frac{\Delta E}{kT} \exp\left(-2\alpha R - \frac{\Delta E}{kT}\right), \qquad (1)$$

где  $\alpha$  — скорость спада волновой функции электрона в потенциальной яме, создаваемой дефектом,  $\Delta E$  энергия активации прыжкового обмена зарядами, связанная с энергетическими положениями уровней дефекта в запрещенной зоне и уровнем Ферми, c — коэффициент, определяемый спектром фононов.

Предположим далее, что дефект может находиться в зарядовом состоянии, отличном от 0, некоторое время  $\tau$ , а затем снова возвращается в нейтральное состояние. Тогда по аналогии с [8] концентрацию дефектов в заряженных состояниях можно оценить следующим образом:

$$N^+ = N^- = \frac{NP(T)\tau}{aP(T)\tau + 1}.$$
 (2)

В отсутствие электрического поля направления прыжков равновероятны. В электрическом поле с напряженностью **E** вероятности прыжков по направлению **E** и против него отличаются на величину  $\exp\left(\pm \frac{eRE}{kT}\right)$ .

Таким образом, в объеме кристалла появятся нескомпенсированные диполи, концентрацию которых получим, умножив P(T) в выражении (2) на sh  $\left(\frac{eRE}{kT}\right)$ :

$$N_{\rm dip} = \frac{NP(T)\tau \operatorname{sh}\left(\frac{eRT}{kT}\right)}{2P(T)\tau \operatorname{sh}\left(\frac{eRE}{kT}\right) + 1}.$$
(3)

Используя соотношения  $P = N_{dip}p = N_{dip}eR$ ,  $P = \varepsilon_0 \chi E$  и (3), определим дополнительный вклад в диэлектри-

ческую восприимчивость, вызванный прыжковой перезарядкой дефектов:

$$\chi_p = \frac{NP(T)\tau \operatorname{sh}\left(\frac{eRE}{kT}\right)}{\left[2P(T)\tau \operatorname{sh}\left(\frac{eRE}{kT}\right) + 1\right]} \frac{eR}{\varepsilon_0 E}.$$
(4)

В случае слабых полей выражение (4) упрощается:

$$\chi_p = \frac{NP(T)\tau e^2 R^2}{\varepsilon_0 kT}.$$
(5)

При  $P(T)\tau \ll 1$  произведение  $NP(T)\tau$ , согласно (2), является полной концентрацией диполей (в отличие от (3), где дана концентрация нескомпенсированных диполей). Тогда

$$\chi_p = \frac{N^+ e^2 R^2}{\varepsilon_0 k T} \tag{6}$$

и  $\chi_p$  с точностью до коэффициента 3 совпадает с величиной, определяемой формулой Дебая–Ланжевена [9]

$$\chi = \frac{Ne^2 R^2}{3\varepsilon_0 kT},\tag{7}$$

описывающей диэлектрическую восприимчивость кристалла с N диполями.

Таким образом, прыжковая перезарядка многозарядных дефектов, вносящих глубокие уровни в запрещенную зону, в присутствии внешнего электрического поля должна привести к росту диэлектрической проницаемости.

При выводе выражений (4) и (5) мы предполагали  $\tau = \text{const.}$  При этом дополнительный вклад в  $\chi_p$ ,

вызванный прыжковой перезарядкой, можно наблюдать только для частот  $f \leq 2/\tau$ . Однако для разных дефектов времена  $\tau$  могут различаться между собой. Если они находятся в интервале  $\tau_{\min} \leq \tau \leq \tau_{\max}$ , то  $\chi_p$  должна уменьшаться начиная с частоты  $f \simeq 2/\tau_{\max}$  и при  $f > 2/\tau_{\min}$  обратиться в нуль.

## 2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Для измерений температурных зависимостей диэлектрической проницаемости полуизолирующих материалов  $Cd_{1-x}Mn_x$ Te ( $0 \le x \le 0.7$ ) были изготовлены конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемых материалов толщиной 0.45 мм. Обкладки конденсаторов были получены нанесением серебряной токопроводящей пасты на поверхности пластинок. Измерения емкости и сопротивления проводились цифровым измерителем иммитанса E7-14 на частотах 0.1, 1 и 10 кГц. Точность измерений составляла ±0.1%. Температура изменялась от 80 до 450 К. Точность измерения температуры составляла ±0.5 К.

На рис. 1,2 приведены температурные зависимости емкости конденсатора с диэлектриком  $Cd_{1-x}Mn_x$ Те различного состава. Из рисунка видно, что при низких температурах величина диэлектрической проницаемости составляет около 9 и совпадает со значением, полученным из оптических измерений в инфракрасной области спектра [10]. В табл. 1 приведены величины энергий активации роста диэлектрической проницаемости  $\Delta E^C$ ,



**Рис. 1.** Температурные зависимости емкости  $Cd_{0.85}Mn_{0.15}$ Те для частот измерений: f, кГц: I = 0.1, 2 = 1, 3 = 10.



**Рис. 2.** Температурные зависимости емкости материалов  $Cd_{1-x}Mn_x$  Te  $0 \le x \le 0.7$ , f = 10 кГц. Значения x: I = 0, 2 = 0.15, 3 = 0.3, 4 = 0.5, 5 = 0.7.



Рис. 3. Температурные зависимости сопротивления  $Cd_{0.85}Mn_{0.15}$ Те для частот измерений: f, кГц: 1 - 0.1, 2 - 1, 3 - 10.

которые отсчитываются от края зоны проводимости, определенные из зависимостей  $\lg C = f(1/T)$  для полупроводников различного состава. С ростом частоты измерений наблюдается уменьшение емкости, как это следует из выражений (4)–(5).

На рис. 3 приведены температурные зависимости сопротивления образца  $Cd_{0.85}Mn_{0.15}$ Те. Сопротивление существенно зависит от частоты измерений, что свидетельствует о прыжковом механизме переноса зарядов в нем [6]. Согласно [6], зависимость проводимости от частоты в этом случае описывается выражением

$$\sigma = \sigma_0 f^s, \tag{8}$$

где *s*  $\leq$  0.8. Выражение (8) справедливо только в тех областях температур, где проводимость определяется прыжковой перезарядкой дефектов одного типа. Исходя из этого на зависимостях R(1/T) были выбраны такие температуры, при которых участок спада сопротивления наблюдается для всех трех частот измерений (см. рис. 3). На рис. 4 приведены зависимости проводимости от частоты измерений для материалов разного состава, а также зависимость  $\sigma = \sigma_0 f^{0.8}$ . Из рис. 4 видно, что для всех исследованных материалов проводимость зависит от частоты измерений, а показатель *s* в выражении (8) во всех случаях меньше, чем 0.8. Совпадение температурных участков возрастания диэлектрической проницаемости и проводимости (рис. 1 и 3), энергий активации возрастания емкости  $\Delta E^C$  и проводимости  $\Delta E^R$  (табл. 1) и наличие частотных зависимостей емкости и проводимости могут свидетельствовать о том, что все вышеперечисленные процессы определяются прыжковым обменом зарядами между дефектами.

Для того чтобы в силу прыжковой перезарядки произошло столь существенное возрастание диэлектрической проницаемости (до значений  $\varepsilon \simeq 200$ , т.е. более чем в 10 раз), необходимы концентрации дефектов порядка  $10^{19} \div 10^{20}$  см<sup>-3</sup> [2]. Для определения концентрации



**Рис. 4.** Частотная зависимость проводимости материалов  $Cd_{1-x}Mn_x$  Te  $0 \le x \le 0.7$ . Состав твердого раствора и температура измерений: I - x = 0, T = 358 K; 2 - x = 0.15, T = 278 K; 3 - x = 0.3, T = 283 K; 4 - x = 0.5, T = 328 K; 5 - x = 0.7, T = 378 K; штриховой линией показана зависимость типа  $\sigma = \sigma_0 f^{0.8}$ .

Физика и техника полупроводников, 1997, том 31, № 6

x	$\Delta E_1^C$ , эВ	$\Delta E_1^R$ , эВ	$\Delta E_2^C$ , эВ	$\Delta E_2^R$ , эВ	$E_g,$ эВ
0	< 0.12	_	$0.25\pm0.05$	$0.28\pm0.05$	1.50
0.15	$0.12\pm0.03$	$0.12\pm0.03$	$0.14\pm0.03$	$0.13\pm0.03$	1.71
0.30	$0.27\pm0.05$	$0.29\pm0.05$	Не обнаружены		1.90
0.50	$0.25\pm0.05$	$0.25\pm0.05$	в измеренном		2.19
0.70	$0.60\pm0.10$	$0.57\pm0.10$	температурном интервале		2.40

дефектов, имеющихся в материалах  $Cd_{1-x}Mn_xTe$ , были измерены спектры ЭПР при T = 77 К. Результаты измерений показали, что в материалах с  $x \ge 0.15$  наблюдается широкая изотропная линия, параметры которой g-фактор и полуширина линии  $\Delta H$ , а также концентрация дефектов, ответственных за ее появление, приведены в табл. 2. Из данных ЭПР следует, что в полупроводниках  $Cd_{1-x}Mn_x$ Te имеются парамагнитные центры, концентрация которых может быть достаточно велика для того, чтобы прыжковый обмен зарядами между ними привел к возрастанию диэлектрической проницаемости.

В СdTe при температуре 77 K диэлектрическая проницаемость примерно в 3 раза превышает значение, характерное для материалов с x > 0 при этой температуре. Это означает, что в CdTe существуют в большой концентрации также дефекты, прыжковая перезарядка которых начинается при температурах, меньших 77 К. Сказать что-либо определенное о величине энергии активации диэлектрической проницаемости не представляется возможным. Можно только предполагать, что она не превосходит величины  $\Delta E_1^C$  для x = 0.15, т.е. 0.12 эВ.

Из табл. 1 и рис. 2 видно, что после введения Мп в концентрации x = 0.15 не были обнаружены в заметном количестве дефекты, ответственные за дополнительную поляризацию CdTe при низких температурах. Так как Mn замещает Cd, можно предположить, что эти дефекты являются дефектами подрешетки Te, а введение Mn приводит к изменению положения их энергетических уровней в запрещенной зоне и, следовательно, к изменению зависимости  $\varepsilon(1/T)$ .

На рис. 5 приведены энергии активации прыжковой перезарядки и ширина запрещенной зоны, полученная из измерений коэффициента отражения света, в зависимости от концентрации Мп. Как видно из рис. 5, зависимость  $E_g(x)$  является линейной во всем исследованном диапазоне концентраций Мп, а зависимость  $\Delta E_1^C(x)$  не

**Таблица 2.** Результаты измерений электронного парамагнитного резонанса (77 K) в кристаллах Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te

x	g	$\Delta H, \Gamma c$	$N$ , см $^{-3}$
0.15	2.0035	390	$2.22\cdot 10^{21}$
0.30	2.0050	215	$4.49 \cdot 10^{21}$
0.50	2.0128	240	$7.58 \cdot 10^{21}$
0.70	2.0152	220	$1.08 \cdot 10^{22}$

является монотонной. До значений x = 0.30 величина  $\Delta E_1^C$  возрастает с ростом *x*, затем не изменяется до x = 0.50, а потом резко возрастает.

Аналогичная зависимость величины от *x* характерна и для ширины линии сигнала ЭПР. Величина g-фактора также является немонотонной функцией x (табл. 2). Анализ полученных результатов, и в первую очередь немонотонного изменения энергий активации  $\Delta E^C$  и  $\Delta E^R$ , позволили разработать модель дефектов, прыжковая перезарядка которых определяет диэлектрическую проницаемость и проводимость на переменном токе компенсированных полупроводников Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. Свойства дефектов определяются прежде всего их микроскопической структурой, т.е. в нашем случае числом входящих в их состав атомов Mn, которое в зависимости от концентрации *х* может принимать дискретные значения от 0 до 4. Поэтому можно предположить, что при x = 0.15в состав дефекта с энергией активации  $\Delta E_1 = 0.12$  эВ входит один атом Mn. Для x = 0.3 и 0.5 в состав дефекта с  $\Delta E_1 \simeq 0.27$  эВ могут входить 2 атома Мп, а при x = 0.7(дефект с  $\Delta E_1 \simeq 0.60$  эВ) — 3 атома Мл. Вторым компонентом дефектов, проявляющихся на первой стадии роста диэлектрической проницаемости, может быть примесь или вакансия в подрешетке Те.

На рис. 6 представлена модель структуры дефектов, которые могут быть ответственны за процессы прыжкового переноса зарядов в материалах Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te (0  $\leq x \leq 0.7$ ). Исходя из предполагаемой модели структуры дефектов, отличающихся различным числом входящих в их состав атомов Mn, можно объяснить наблюдаемые различия в изменениях с концентрацией Мп ширины запрещенной зоны  $E_g$  и энергии активации прыжковой перезарядки  $\Delta E_1^C$  (рис. 5). Величина  $E_g$  определяется для целого кристалла и является непрерывной функцией концентрации Mn. В то же время свойства дефектов являются локальными и определяются небольшим числом атомов, входящих в их состав. Поэтому свойства дефектов должны дискретно изменяться вместе с числом входящих в них атомов Mn. Следовательно, зависимость  $\Delta E_1$  от x должна быть немонотонной функцией. При значениях х, близких к 0, дефектом является примесь либо вакансия Те в узле подрешетки Те, обозначенная на рис. 6 как D, а энергия активации для него  $\Delta E_1 < 0.12$  эВ. Для  $x \simeq 0.25$  в состав дефекта входит атом Mn, при этом  $\Delta E_1 \simeq 0.12$  эВ. При значениях x, находящихся в окрестностях 0.5, дефект



**Рис. 5.** Энергии активации прыжковой перезарядки  $\Delta E_1^C$  и  $\Delta E_2^C$  на 1-й (1) и 2-й (2) стадиях возрастания емкости, а также ширина запрещенной зоны  $E_g$  (3) в зависимости от концентрации атомов Mn.



**Рис. 6.** Модель струкутры дефектов, *D* — вакансия или примесь в узле подрешетки Те.

содержит 2 атома Мп. При этом  $\Delta E_1 = 0.25$  эВ. При значениях *x*, находящихся в окрестностях 0.75, дефект вклчает 3 атома Мп, а его энергия активации составляет 0.60 эВ.

Исходя из этой модели становится понятным нелинейное изменение ширины линии сигнала ЭПР и *g*фактора (табл. 2) с концентрацией Мп. Для каждого из приведенных типов дефектов должны быть характерны свои параметры сигнала ЭПР. Сигнал от  $Cd_{1-x}Mn_x$ Те при разных концентрациях Мп обусловлен комбинацией дефектов нескольких типов, что и приводит к нелинейным зависимостям *g*-фактора и ширины линии сигнала ЭПР от концентрации атомов Мп.

### Заключение

При исследованиях диэлектрических свойств тройных полупроводниковых соединений  $Cd_{1-x}Mn_x$  Те (0  $\leq x \leq 0.7$ ) обнаружено явление термически

активируемого возрастания диэлектрической проницаемости, имеющее ярко выраженную частотную зависимость. Установлена определенная корреляция между основными характеристиками данного эффекта и содержанием Mn в этих материалах. Предложены модели структуры дефектов, прыжковая перезарядка которых приводит, по нашему мнению, к росту диэлектрической проницаемости исследованных полуизолирующих соединений.

#### Список литературы

- P.W. Zukowski, S.B. Kantorow, D. Maczka, V.F. Stelmakh. Phys. St. Sol. (a), **112**, 695 (1989).
- [2] P.W. Zukowski, S.B. Kantorow, K. Kiszczak, D. Maczka, A. Rodzik, V.F. Stelmakh, E. Czarnecka-Such. Phys. St. Sol. (a), **128**, 117 (1991).
- [3] П.В. Жуковский, С.Б. Канторов, Д. Мончка, А. Родзик. К. Кищак, В.Ф. Стельмах. ДАН Белоруссии, 37, 41 (1993).
- [4] С.А. Медведев, С.Н. Максимовский, Ю.В. Клевков, П.В. Шапкин. Теллурид кадмия (М., Наука, 1968).
- [5] Физика соединений А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup>, под ред. А.Н. Георгобиани и М.К. Шейнкмана (М., Наука, 1986).
- [6] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах (М., Мир, 1982) т. 1.
- [7] S.S. Kirkpatrick. Proc. 5th Int. Conf. on Amorphous and Liquid Semicond. (Garmish-Partenkirchen, 1973) p. 183.
- [8] С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках (М., Физматгиз, 1963).
- [9] Ч. Киттель. Элементарная физика твердого тела (М., Мир, 1965).
- [10] В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко. Оптические свойства полупроводников. Справочник (Киев, Наук. думка, 1987).

Редактор Т.А. Полянская